

■ **APIT R & D SA**, à Sion, développement de technologies et d'équipement basés sur la technique des plasmas atmosphériques, société anonyme (FOSC no 216 du 05. 11. 1999, p. 7553). Personne et signature radiée: Cocedes SA, à Genève, organe de révision. Inscription ou modification de personne: Fiva SA, à Sierre, organe de révision.
Journal no 217 du 07.02.2003
(00861058 / CH-660.0.860.995-3)